



MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

NUMERO DE PUBLICATION : 1004446A3

NUMERO DE DEPOT : 9000599

Classif. Internat.: G01B G21K

Date de délivrance : 24 Novembre 1992

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 28 Mars 1984 sur les brevets d' invention, notamment l' article 22;

Vu l' arrêté royal du 2 Décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d' invention, notamment l' article 28;

Vu le procès verbal dressé le 13 Juin 1990 à 11h00
à l' Office de la Propriété Industrielle

ARRETE:

ARTICLE 1.- Il est délivré à : SOLVAY (Société Anonyme)
rue du Prince Albert 33, B-1050 BRUXELLES(BELGIQUE)

représenté(e)(s) par : ANTHOINE Paul, SOLVAY - Département Prop. Indus., Rue de Ransbeek, 310 - 1120 BRUXELLES.

un brevet d' invention d' une durée de 20 ans, sous réserve du paiement des taxes annuelles, pour : INSTALLATION POUR L'ANALYSE D'UN MATERIAU.

ARTICLE 2.- Ce brevet est délivré sans examen préalable de la brevetabilité de l' invention, sans garantie du mérite de l' invention ou de l' exactitude de la description de celle-ci et aux risques et périls du(des) demandeur(s).

Bruxelles, le 24 Novembre 1992
PAR DELEGATION SPECIALE :

G. DE CUYPERE
Secrétaire d'administration

Installation pour l'analyse d'un matériau.

L'invention concerne une installation pour l'analyse d'un matériau au moyen d'une méthode non destructive utilisant les propriétés des rayonnements électromagnétiques.

Les méthodes d'analyse non destructive des matériaux, utilisant des rayonnements électromagnétiques, notamment des rayons X ou gamma, impliquent la mise en oeuvre de mesures de sécurité destinées à éviter une irradiation accidentelle des utilisateurs.

Dans le document DE-A-3522779 (Twin City International, Inc.), on décrit un appareil pour l'analyse d'un matériau par la méthode de la fluorescence X. Cet appareil comprend un support pour le matériau à analyser, une source de rayons X disposée au-dessus du support et un détecteur du rayonnement fluorescent émis par le matériau irradié par la source de rayons X. Il comprend en outre un écran escamotable, destiné à être interposé entre la source de rayons X et le support du matériau, pour interrompre l'irradiation du matériau et du support; pendant l'analyse, l'écran est escamoté pour permettre l'irradiation du matériau. Cet appareil connu nécessite d'être manoeuvré avec prudence, par un personnel averti, conscient du risque encouru en cas de manipulation du matériau sur le support sans que l'écran ait été placé en regard de la source de rayons X. Il peut être la cause d'irradiations accidentelles, dans le cas où, par oubli ou négligence, on omet de manoeuvrer l'écran avant de manipuler un matériau sur le support.

L'invention remédie à cet inconvénient de l'appareil connu décrit ci-dessus, en fournissant une installation pour l'analyse des matériaux au moyen d'une méthode par rayonnement électromagnétique, dont l'exploitation est aisée et qui supprime le risque d'irradiation accidentelle de l'utilisateur.

L'invention concerne dès lors une installation pour l'analyse d'un matériau, comprenant un support du matériau, une sonde de mesure comprenant une source d'un rayonnement électromagnétique, un écran disposé en regard de la source, l'écran
5 étant escamotable, et un dispositif pour déplacer le support et/ou la source entre une position de chargement permettant la pose du matériau sur le support ou l'enlèvement du matériau du support et une position de mesure pour laquelle le matériau est en regard de la source; selon l'invention, la source et le
10 support sont disposés dans une enceinte comprenant un couvercle escamotable et l'écran est disposé entre la source et le couvercle.

Dans l'installation selon l'invention, la sonde de mesure a pour fonction de mesurer une grandeur caractéristique du matériau
15 soumis à un rayonnement électromagnétique. A cet effet, elle comprend une source de rayonnement électromagnétique et un analyseur. La source de rayonnement électromagnétique peut être par exemple une source de rayons X ou de rayons gamma. L'analyseur peut par exemple comprendre un dispositif d'analyse
20 spectroscopique par fluorescence X ou gamma ou un dispositif d'analyse basé sur la diffraction des rayons X.

L'écran a pour fonction de constituer un obstacle à la propagation du rayonnement électromagnétique provenant de la source, lorsqu'il est disposé en regard de celle-ci. Le matériau
25 de l'écran dépend dès lors de l'énergie du rayonnement électromagnétique émis par la source. Dans le cas d'une source à rayons X ou gamma, on peut utiliser un écran en acier. L'écran est escamotable, ce qui signifie qu'il peut être écarté de la source de manière à ne plus faire obstacle à la propagation du
30 rayonnement électromagnétique. L'escamotage de l'écran peut par exemple consister en un déplacement latéral ou un basculement de l'écran.

L'écart entre le support et la source est ajustable entre une position de chargement et une position de mesure. L'écart
35 correspondant à la position de mesure est celui pour lequel un matériau à analyser, posé sur le support, est situé en regard de

la source dans une position définie pour laquelle il subit une irradiation contrôlée. L'écart correspondant à la position de chargement est celui pour lequel le support est suffisamment écarté de la source pour permettre la mise en place de l'écran en face de la source et soustraire le matériau présent sur le support, à l'action du rayonnement électromagnétique. L'ajustage de l'écart entre le support et l'écran est obtenu par déplacement de la source ou du support.

Selon l'invention, la source et le support sont disposés dans une enceinte munie d'un couvercle escamotable. L'enceinte et le couvercle sont en un matériau capable de faire obstacle à une propagation du rayonnement électromagnétique de la source. Ce matériau peut être le même que celui de l'écran. Le couvercle est escamotable, ce qui signifie qu'il peut être suffisamment écarté pour ne plus faire obstacle à une propagation du rayonnement électromagnétique généré par la source. L'escamotage du couvercle peut consister en un déplacement latéral ou un basculement du couvercle. Par ailleurs, selon l'invention l'écran est disposé entre la source et le couvercle. Du fait de cette particularité de l'installation selon l'invention, l'écran ou le couvercle peuvent constituer séparément des obstacles à une propagation du rayonnement électromagnétique de la source en dehors de l'enceinte.

Dans l'installation selon l'invention, l'écran et le couvercle peuvent être verticaux, oblique ou horizontaux. On préfère, selon une forme de réalisation particulière de l'invention, avoir la source disposée sous l'écran et le couvercle disposé au-dessus de l'écran. Dans cette forme de réalisation de l'installation selon l'invention, l'écran et le couvercle sont horizontaux et leur escamotage se fait de préférence par coulissement horizontal. Le support peut par exemple comprendre des appuis disposés au voisinage de la source et déplaçables verticalement.

Dans une forme de réalisation avantageuse de l'installation selon l'invention, les manoeuvres respectives de l'écran et du couvercle entre leur position en regard de la source et leur

position escamotée sont interdépendantes, de manière à avoir en permanence un obstacle entre la source de rayonnement électromagnétique et l'utilisateur de l'installation. A cet effet, l'installation comprend un organe de manoeuvre de l'écran et un
5 organe de manoeuvre du couvercle, qui sont couplés à un organe d'asservissement qui est conçu pour que le couvercle soit fermé lorsque l'écran est escamoté et pour que l'écran soit en regard de la source lorsque le couvercle est escamoté. Dans une variante de cette forme de réalisation de l'installation, le dispositif
10 pour déplacer le support et/ou la source entre les positions de chargement et de mesure est couplé à un asservisseur qui est conçu pour opérer ce déplacement lorsque le couvercle est fermé et l'écran escamoté, et pour empêcher ledit déplacement lorsque l'écran est en regard de la source, le couvercle étant escamoté.

15 L'installation peut indifféremment comprendre une ou plusieurs sondes de mesure, comprenant une ou plusieurs sources de rayonnement électromagnétique. Dans le cas de plusieurs sources de rayonnement électromagnétique, l'écran et le couvercle doivent être conçus pour faire obstacle à la propagation du
20 rayonnement électromagnétique, lorsqu'ils sont placés en regard des sources. En variante, l'installation peut comprendre un écran individuel et un couvercle individuel pour chaque source.

L'installation selon l'invention est spécialement adaptée à l'analyse des matériaux par la méthode de la fluorescence X. Elle
25 trouve notamment une application à la mesure ou au contrôle de l'épaisseur du revêtement métallique actif des électrodes utilisées dans les procédés d'électrolyse des solutions aqueuses de chlorure de métal alcalin visant à la production de chlore, de solutions aqueuses d'hydroxyde de métal alcalin et de solutions
30 aqueuses de chlorate de métal alcalin. Elle présente l'avantage d'éviter tout risque d'irradiation accidentelle et peut dès lors être utilisée par des opérateurs non professionnellement exposés.

Des particularités et détails de l'installation selon l'invention vont ressortir de la description suivante des dessins
35 annexés.

La figure 1 montre en plan, avec arrachement partiel, une forme de réalisation particulière de l'installation selon l'invention, dans laquelle le support occupe la position de chargement;

5 La figure 2 est une coupe selon le plan II-II de la figure 1;

La figure 3 est une vue analogue à la figure 2, de l'installation des figures 1 et 2, dans laquelle le support occupe la position de mesure;

10 La figure 4 est une vue analogue à celle de la figure 3, dans laquelle le support porte un matériau soumis à l'analyse.

Dans ces figures, de mêmes notations de référence désignent des éléments identiques.

15 L'installation représentée aux figures comprend un bâti métallique 1 entouré d'une enceinte 2, ouverte à sa partie supérieure.

A l'intérieur de l'enceinte 2, le bâti 1 supporte quatre sondes de mesure 3 comprenant chacune une source de rayonnement électromagnétique. Celle-ci peut par exemple être constituée de cadmium 109.

20 Trois appuis 4, supportés par des poutrelles 5 du bâti 1, sont disposés autour des sondes 3 et servent à supporter les matériaux à analyser. Les appuis 4 sont déplaçables verticalement au moyen de vérins 14.

25 Un écran horizontal 6 est mobile entre une position pour laquelle il est situé au-dessus des sondes 3 (figures 1 et 2) et une position escamotée, pour laquelle il se trouve écarté des sondes 3 (figures 3 et 4). A cet effet, l'écran 6 est équipé de galets 7 circulant sur un chemin de roulement 8 posé sur des traverses (non représentées) du bâti 1. L'écran 6 présente une échancrure médiane 13 pour permettre son déplacement sur le chemin de roulement 8 et le passage d'un des appuis 4.

30 Un second chemin de roulement horizontal 9, posé sur des traverses (non représentées) du bâti 1, porte un couvercle constitué d'une paire de panneaux 10. Ceux-ci sont déplaçables en sens opposés sur le chemin de roulement 9, au-dessus de l'écran

6, entre une position pour laquelle ils sont écartés l'un de l'autre (figures 1 et 2) et une position pour laquelle ils sont jointifs (figures 3 et 4).

5 Le déplacement de l'écran 6 sur son chemin de roulement 8 est assuré au moyen d'un vérin 11 solidarisé au bâti 1. Le déplacement des panneaux 10 sur leur chemin de roulement 9 est assuré par l'intermédiaire d'une paire de vérins 12 solidaires du bâti 1.

10 Le vérin 11, les vérins 12 et les vérins 14 peuvent être par exemple des vérins à fonctionnement hydraulique ou pneumatique. Ces vérins sont reliés à un dispositif de régulation (non représenté) qui assure le fonctionnement automatique de l'installation. Ce dispositif de régulation comprend un organe d'asservissement qui régule l'actionnement des vérins 11 et 12 et
15 un asservisseur qui régule l'actionnement des vérins 14 en fonction de l'actionnement des vérins 11 et 12.

Pour analyser un matériau, on opère en plusieurs étapes.

20 Dans une première étape, on manoeuvre le dispositif de régulation pour amener les appuis 4 dans la position de chargement. Le dispositif de régulation réagit dès lors automatiquement en exécutant les fonctions successives suivantes : la montée des appuis 4; le déplacement de l'écran 6 pour amener celui-ci au-dessus des sondes 3; le déplacement des panneaux 10 pour les écarter l'un de l'autre.

25 Dans une seconde étape, on dépose le matériau à analyser sur les appuis 4.

Dans une troisième étape, on actionne le dispositif de régulation pour amener les appuis 4 dans la position de mesure. Le dispositif de régulation réagit alors automatiquement en
30 exécutant les fonctions successives suivantes : le déplacement des panneaux 10 vers la position de fermeture pour laquelle ils sont jointifs; l'escamotage de l'écran 6; la descente des appuis 4, ce qui a pour résultat de mettre le matériau en position d'analyse en regard des sondes 3. A l'issue de cette troisième
35 étape le matériau est soumis à l'action du rayonnement électromagnétique et les résultats de l'analyse sont transférés

automatiquement vers un tableau d'affichage, une imprimante ou un ordinateur pour y être traités.

Dans une quatrième étape, qui fait suite à l'analyse du matériau, on actionne le dispositif de régulation pour permettre la récupération du matériau. Le dispositif de régulation réagit alors en exécutant automatiquement la séquence des fonctions suivantes : actionnement des vérins 14 pour obtenir la montée des appuis 4; actionnement du vérin 11 pour obtenir le déplacement de l'écran 6 au-dessus des sondes 3; actionnement des vérins 12 pour obtenir l'écartement des panneaux 10.

Dans une forme de réalisation modifiée de l'installation qui vient d'être décrite, les appuis 4 sont fixes et ce sont les sondes 3 qui sont déplaçables verticalement.

L'installation selon l'invention trouve une application intéressante dans la mesure de l'épaisseur du revêtement métallique actif des anodes des cellules d'électrolyse utilisées pour la production de chlore. Ces anodes comprennent en effet généralement un substrat en métal filmogène (titane, tantale, niobium, tungstène et alliage de ces métaux), portant un revêtement électroconducteur. Pendant l'exploitation de ces anodes dans une cellule d'électrolyse, le revêtement s'use progressivement et il est dès lors intéressant de pouvoir contrôler périodiquement l'épaisseur du revêtement résiduel, afin d'assurer un fonctionnement optimum de la cellule d'électrolyse. La figure 4 montre une telle anode 15 en position d'analyse sur les appuis 4 de l'installation selon l'invention. L'anode 15 est posée sur les appuis 4 de manière que le revêtement 16 dont on désire connaître l'épaisseur soit orienté vers les sondes 3. Une tige cylindrique 17 de l'anode traverse un orifice correspondant du couvercle, formé de deux découpes semi-cylindriques pratiquées dans les bords jointifs des panneaux 10. Dans cette application de l'invention, le revêtement 16 de l'anode 15 est irradié par le rayonnement X émis par les sondes 3 et celles-ci mesurent l'intensité du rayonnement fluorescent produit par le revêtement. L'intensité du rayonnement fluorescent étant proportionnelle à la quantité de revêtement irradié, elle permet de déterminer

l'épaisseur de celui-ci.

Dans une variante de réalisation avantageuse, l'installation qui vient d'être décrite comprend un dispositif de centrage du matériau à analyser sur les appuis. Dans le cas d'une
5 installation destinée à l'analyse de matériaux de format défini (par exemple des électrodes de section transversale carrée ou rectangulaire), le dispositif de centrage peut comprendre des vérins destinés à repousser le matériau contre des butées fixes.

RE V E N D I C A T I O N S

1 - Installation pour l'analyse d'un matériau, comprenant un support du matériau, une sonde de mesure comprenant une source d'un rayonnement électromagnétique, un écran disposé en regard de la source, l'écran étant escamotable, et un dispositif pour
5 déplacer le support et/ou la source entre une position de chargement permettant la pose du matériau sur le support ou l'enlèvement du matériau du support et une position de mesure pour laquelle le matériau est en regard de la source, caracté-
10 risée en ce que la source et le support sont disposés dans une enceinte comprenant un couvercle escamotable et en ce que l'écran est disposé entre la source et le couvercle.

2 - Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la source est disposée sous l'écran et le couvercle est
15 disposé au-dessus de l'écran.

3 - Installation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'un organe de manoeuvre de l'écran et un organe de manoeuvre du couvercle sont couplés à un organe d'asservissement conçu pour que le couvercle soit fermé lorsque l'écran est
20 escamoté et pour que l'écran soit en regard de la source lorsque le couvercle est escamoté.

4 - Installation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le dispositif pour déplacer le support et/ou la source est couplé à un asservisseur conçu pour
25 manoeuvrer le dispositif lorsque le couvercle est fermé et l'écran escamoté.

5 - Installation selon la revendication 4, caractérisée en ce que le dispositif d'asservissement et l'asservisseur sont couplés à un organe d'actionnement unique qui a pour fonction,
30 d'une part, lorsque le support occupe sa position de chargement, d'actionner successivement l'organe de manoeuvre du couvercle pour fermer celui-ci, l'organe de manoeuvre de l'écran pour escamoter celui-ci et le dispositif pour amener le support dans sa position

de mesure et, d'autre part, lorsque le support occupe sa position de mesure, d'actionner successivement le dispositif pour amener le support dans la position de chargement, l'organe de manoeuvre de l'écran pour placer celui-ci en regard de la source et
5 l'organe de manoeuvre du couvercle pour escamoter celui-ci.

6 - Installation selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisée en ce que le support comprend trois appuis déplaçables verticalement.

7 - Installation selon l'une quelconque des revendications 1
10 à 6, caractérisée en ce que l'écran et le couvercle sont montés sur des chemins de roulement et les organes de manoeuvre de l'écran et du couvercle comprennent un couple de vérins.

8 - Installation selon l'une quelconque des revendications 1
15 à 7, caractérisée en ce que la source de rayonnement électromagnétique est une source de rayons X.

9 - Installation selon la revendication 8, pour la mesure de l'épaisseur d'un revêtement métallique sur un substrat, par la méthode de la fluorescence X.

10 - Installation selon la revendication 9, caractérisée en
20 ce que le support est conçu pour l'analyse d'un matériau consistant en une électrode pour cellule d'électrolyse, ladite électrode comprenant un substrat en titane, en tantale, en nobium, en tungstène ou en alliage de ces métaux et un revêtement électroconducteur.

FIG. 1

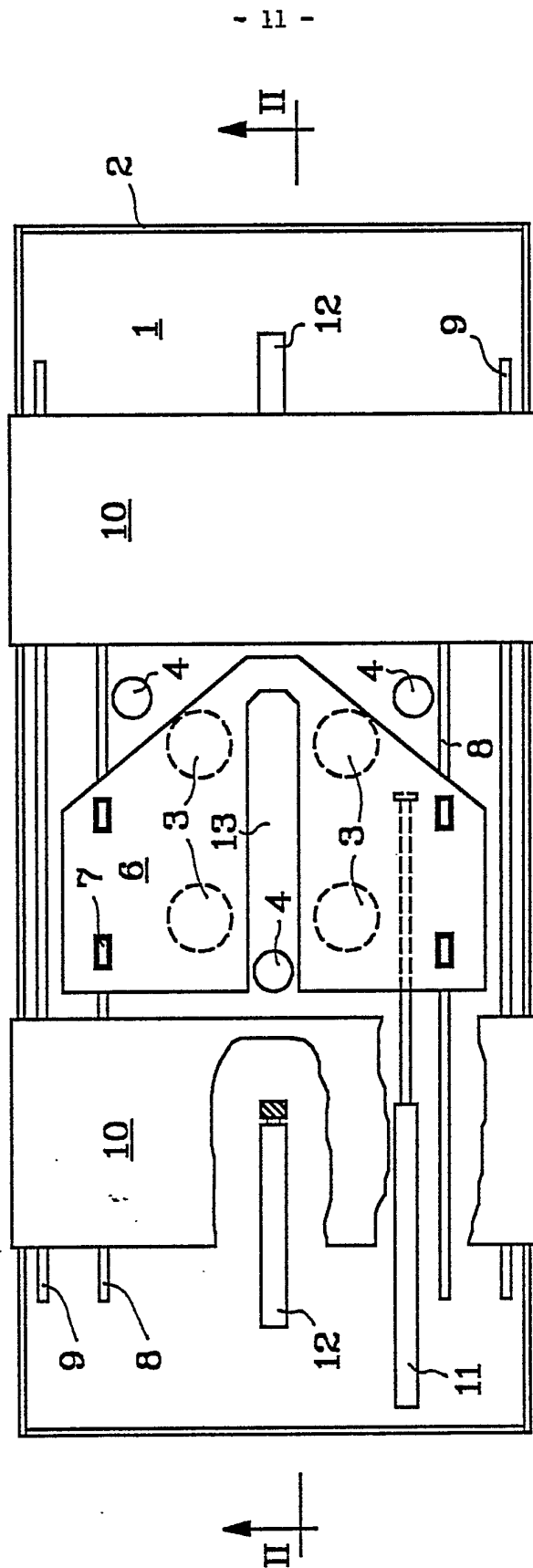


FIG. 2

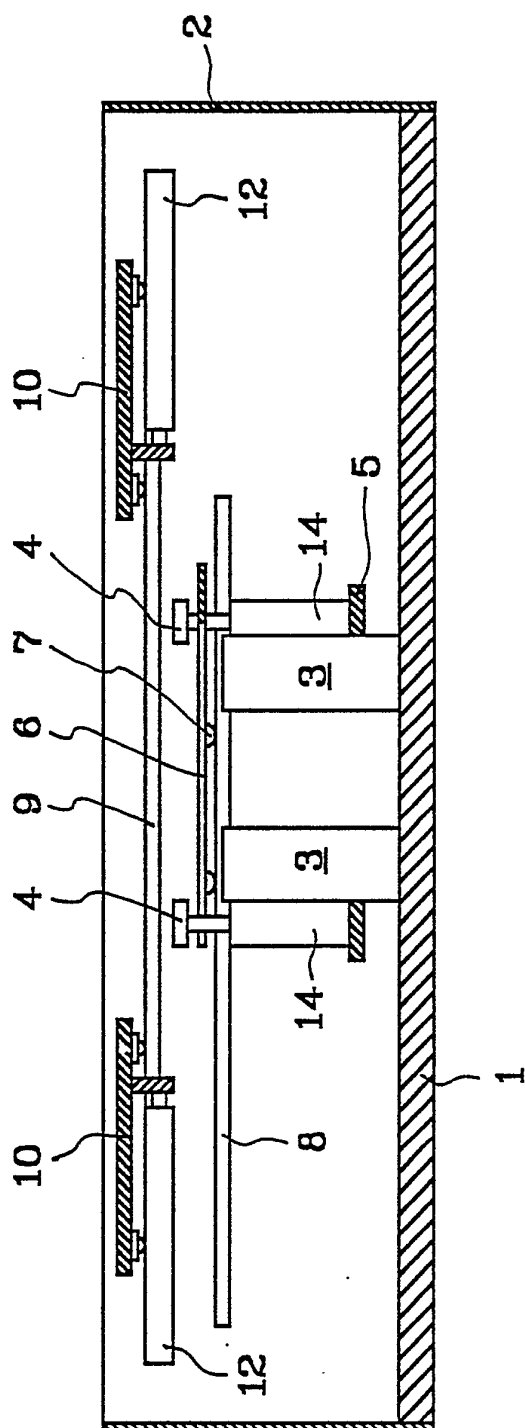


FIG. 3

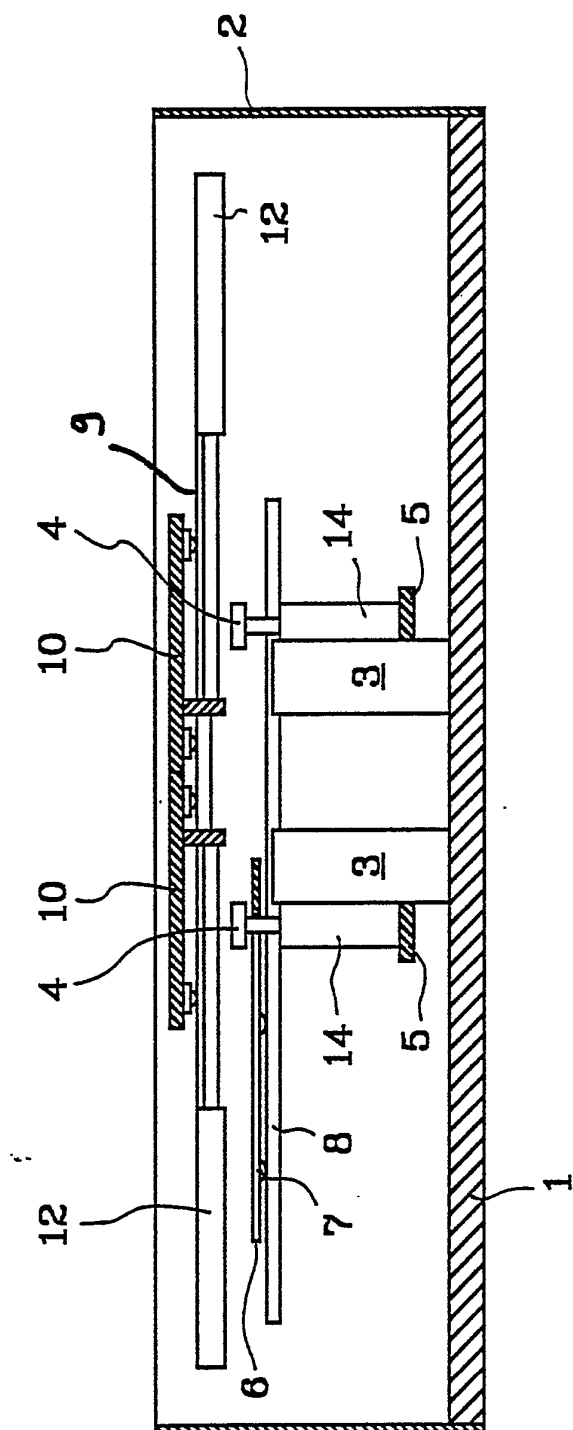
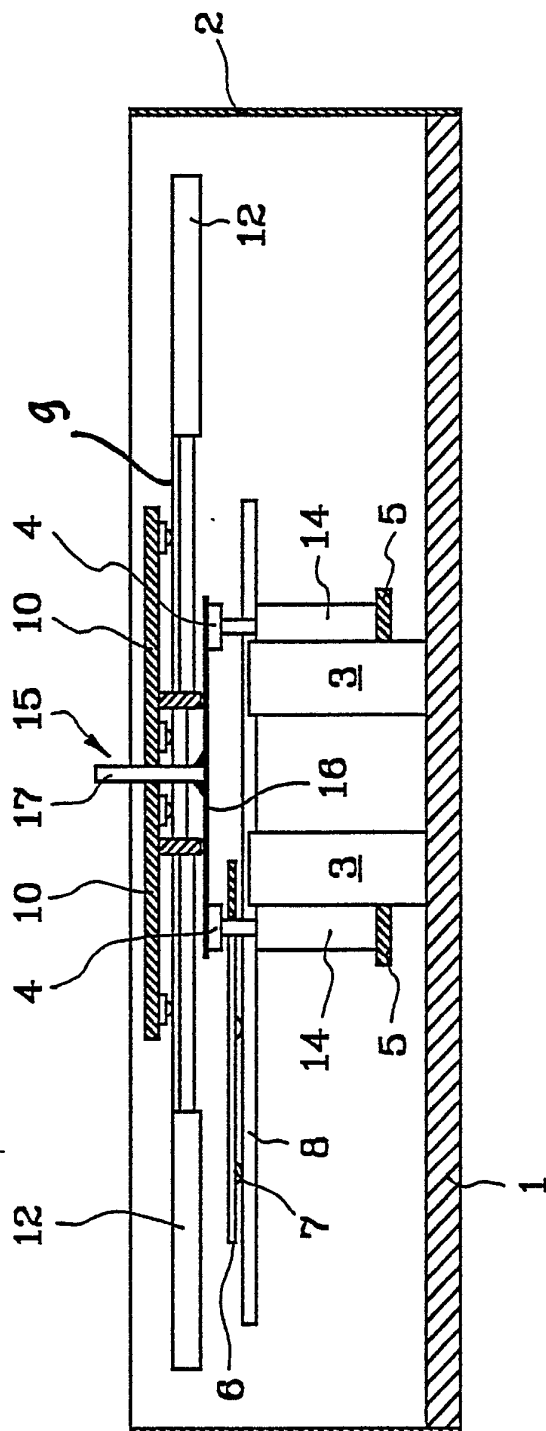


FIG. 4





Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE
établi en vertu de l'article 21 § 1 et 2
de la loi belge sur les brevets d'invention
du 28 mars 1984

Numero de la demande
nationale

BE 9000599
BO 2360

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
Y	US-A-4 692 935 (KUMAKURA et al.) * Colonne 2, ligne 52 - colonne 5, ligne 45 *	1-3	G 01 B 15/02 G 21 K 1/04
A	---	4,5,7,8	
Y	DE-A-3 235 513 (TWIN CITY INTERNATIONAL) * Page 16, ligne 23 - page 19, ligne 9 *	1-3	
A	---	4,5	
A	DE-A-2 004 050 (WERNER & PFLEIDERER) * Colonne 4, ligne 13 - colonne 5, ligne 68 *	1-3,7	
D,A	DE-A-3 522 779 (TWIN CITY INTERNATIONAL) * Page 8, ligne 25 - page 10, ligne 20 *	1,8,9	
A	DD-A- 226 954 (VEB, CHEMIEKOMBINAT BITTERFELD) * Page 1, ligne 1 - page 4, ligne 17 *	1,8-10	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5) G 01 B 15/00 G 21 K 1/00
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
21-02-1991		BINDON C.A.	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET BELGE NO.**

BE 9000599
BO 2360

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 06/03/91

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US-A- 4692935	08-09-87	JP-A- 61129557	17-06-86
DE-A- 3235513	07-04-83	US-A- 4467198	21-08-84
		JP-A- 58063897	15-04-83
DE-A- 2004050	13-05-71	Aucun	
DE-A- 3522779	09-01-86	JP-A- 61025006	03-02-86
DD-A- 226954		Aucun	